(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-365

(43)公開日 平成6年(1994)1月11日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B 0 1 J 19/08

K 9151-4G

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平4-163071

(22)出顧日

平成4年(1992)6月22日

(71)出願人 000101880

イーシー化学株式会社

大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目2番

15号

(71)出願人 591048508

伊藤忠ファインケミカル株式会社

東京都千代田区平河町1丁目2番10号 平

河町第一生命ピル7F

(72)発明者 内山 宏

大阪府校方市星丘二丁目13番20号

(72)発明者 赤染 義一

京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町

145 - 36

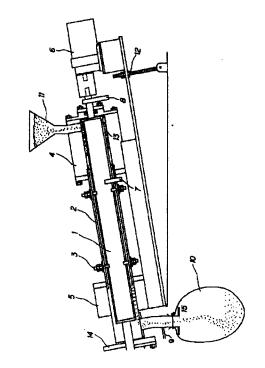
(74)代理人 弁理士 田中 宏 (外1名)

(54)【発明の名称】 粉体のプラズマ処理方法

(57) 【要約】

【目的】大量の粉体を連続的にプラズマ処理を施す粉体 のプラズマ処理方法に関する。

【構成】金属製の内筒の外側と同軸の金属製の外筒の内 側の両方又は何れか一方に誘電体にてライニングを行 い、これら内筒及び外筒を同軸的に軸支して両者間に一 定の間隙を設け、これら内外筒を傾斜し、且つ、回転可 能に設置し、内外簡間に電圧をかけて両者の間隙間に大 気圧プラズマを発生させると共に該間隙間を被処理物で ある粉体を移動させて連続的にプラズマ処理を施すこと を特徴とする粉体のプラズマ処理方法である。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属製の内筒の外側と同軸の金属製の外 筒の内側の両方又は何れか一方に誘電体にてライニング を行い、これら内筒及び外筒を同軸的に軸支して両者間 に一定の間隙を設け、これら内外筒を傾斜し、且つ、回 転可能に設置し、内外筒間に電圧をかけて両者の間隙間 に大気圧プラズマを発生させると共に該間隙間を被処理 物である粉体を移動させて連続的にプラズマ処理を施す ことを特徴とする粉体のプラズマ処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、大量の粉体を連続的に プラズマ処理を施す粉体のプラズマ処理方法に関する。 [0002]

【従来の技術】従来より酸化アルミナ、二酸化チタンな どの顔料や染料などの粉体にプラズマ処理を施してその 表面の親水性を高めて、その濡れ特性を良好にし、水性 又は油性の溶媒中に容易に分散させることが行われてい る。殊に最近粉体の粒度の細かいものが得られるように 要な問題である。本発明者は、先に、これら粉体に大気 圧プラズマ処理を施して分散性を向上させた発明を見出 した (特願平2-195018号)。しかし、この方法 は円筒の外側に電極をとりつけ、円筒内を粉体とヘリウ ム、アルゴン等の大気圧プラズマを発生させるための不 溶性ガスと共に電極間を通過させるという方法である。 したがって、プラズマの処理時間は、ガスの流速に比例 するため極めて短時間となり、粉体に完全にプラズマ処 理を施すことができず、また、円筒内の限られた空間内 いという欠点があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明者は、上記の欠 点を改良し、大量の粉体をより完全にプラズマ処理すべ く種々検討した結果、本発明を完成したもので、本発明 の目的は大量の粉体を連続的に、より長時間プラズマ処 理を施す粉体のプラズマ処理方法を提供するにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の要旨は、金属製 の内筒の外側と同軸の金属製の外筒の内側の両方又は何 40 れか一方に誘電体にてライニングを行い、これら内筒及 び外筒を同軸的に軸支して両者間に一定の間隙を設け、 これら内外筒を傾斜し、且つ、回転可能に設置し、内外 筒間に電圧をかけて両者の間隙間に大気圧プラズマを発 生させると共に該間隙間を被処理物である粉体を移動さ せて連続的にプラズマ処理を施すことを特徴とする粉体 のプラズマ処理方法である。

【0005】すなわち、本発明は、内筒の外側と外筒の 内側との間の間隙を大気圧プラズマを発生させ、その間 隙間を、傾斜及び内外筒の回転によって、粉体を移動さ 50 に実施例をもって、具体的に本発明を説明する。

せてプラズマ処理を施すのであり、したがって、連続的 にプラズマ処理することができ、しかもその移動速度に よって処理時間を調整することができる。

【0006】本発明のプラズマ処理方法を実施するため の装置を図1に示す。図1において、金属よりなる内筒 1の外側に、外筒2を同軸的に内筒1と約5mm~10 mm程度の間隔を保つようにボルト3で保持する。この 際、外筒の内面又は内筒の外面の少なくとも何れか一方 の面を誘電体でライニングを行った。ただ、カーボンブ 10 ラック粉末のような導電性粉末を処理する場合には両方 の面を誘電体でライニングする。誘電体としては、カブ トンのような耐熱性プラスチック、ガラス、セラミック スまたは酸化アルミニウム等を使用する。

【0007】そして、内筒1の一方の端部に、延長して スクリューコンペア-13を接続する。内筒1は、また シャフトによって減速モーター6とフランジ14によっ て廻転できるように支持されており、外筒2は、内筒1 の廻軸と共に廻転できるように絶縁体からなる軸受4及 び5によって支軸されている。外筒の一端には原料供給 なり、これらの粉体を良好に分散させることは極めて重 20 口であるホッパー11を他端には処理された粉体の取出 ロ15を設け、取出口に大気圧プラズマを発生するため の不活性ガス導入口を設け、外筒と内筒の間隙を原料と 向流するようにガスが流れるようにする。また内筒と外 筒とに接触するように燐青銅製の刷子を設け、外筒と内 筒との間にグロー放電を生ずるようにする。装置全体は ポルト及びナット12によって原料供給口側が高く、原 料排出口が低くなるように傾斜して設置する。

【0008】この装置を次のように作動させる。先ず原 料排出口に気体不透過性の袋を取り付け装置内に導入さ でバッチ方式で処理するために大量の粉体が処理できな 30 れるガスが排出口より散逸しないようにする。続いてガ ス導入口9よりヘリウムとアルゴンとの混合ガスを導入 する。このガスは内筒と外筒との間隙を通り、空気を追 い出しながらホッパー11に流出する。間隙内がアルゴ ンとヘリウムの混合ガス雰囲気になった後、ホッパー1 1より原料を装置内に供給し、内筒及び外筒をモーター 6によってゆっくりと回転させる。同時に刷子7及び8 に3KHz、3000Vの高周波電圧を印加すると外筒 と内筒の間隙にグロー放電が起り、プラズマ励起され る。粉体にホッパー11より供給されコンベアベルト1 3を通って内筒と外筒の間隙に送り出され、この間隙を 通過する間にゆっくりと処理され、その粉体表面は著し い親水性を与え、袋10の中に収納される。

> 【0009】本発明において使用する装置の全長は、実 験室規模と工業化規模仕様とは異なるが0.5mから約 10mで、粉体の移動距離は内側電極の長さと同じ距離 であり0. 4mから9mである。この方法においては、 連続的に粉体の表面処理を行うことができるので大多量 に処理できると共に、傾斜角度及び回転速度を変えるこ とによって粉体の移動速度を加減することができる。次

(3)

[0010]

【実施例】

実施例1

本明細書記載の装置の内筒の外側に誘電体として100 ミクロン厚のカプトンをエポキシ樹脂にて張り合せ内筒外筒の間隙を8mmとした。ガスとしてヘリウムガスとアルゴンガスの混合ガスを入口から送り円筒内の空気を置換しつつ1分間10回転で回転させた。このときのガスの混合比はヘリウムガス40部アルゴンガス60部である。両円筒の外側円筒を+側に内側円筒を接地側として3000Hz250のVの電圧を印加した。直ちに両円筒の間隙8mmの間にグロー放電が起りプラズマ励起されるからそのときホッパーより超微粒子のアルミナ粉末を送り込んだ。スクリューにより円筒の間隙に入った粉末は5秒間で出口に達し排出口から袋の中に排出された。この処理された粉末は極めて親水性と分散性が大となり水中に入れたとき無処理のものはそのまま水中に沈むが処理されたものは直ちに分散し乳液状となった。

3

【0011】実施例2

本明細書の円筒の内筒の外側と外筒の内側の両方に50 20 ミクロン厚みのカプトンを張りつけガスとしてアセトンを10ppm含有したアルゴンガスをガス入口から送り円筒内部の空気を置換し1分間20回転で回転させた。外側円筒に5000Hz3500Vの電圧を印加してグロー放電を起し微細なグラファイトの粉末をホッパーより送った。スクリューによって円筒の間隙に入った粉末は極めて軽い為15秒で連続的に排出口から排出された。この粉末は親水性が高く微細な無処理グラファイトが水の上に浮くのに対してブラズマ処理された粉末は直ちに水の中に沈み黒く分散した。著しく高い親水性をも30

つに至った。

[0012]

【発明の効果】以上、述べたように、本発明は粉体をプラズマ励起されている内筒と外筒との間隙をゆっくりと回転しながら移動するため、従来の方法に比してより長時間プラズマ処理を受けることとなり、その結果、得られた粉体の表面は高度に親水性となり、したがって、従来のものに比してはるかに分散性の優れた粉体が得られる。

10 [0013]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の方法を実施するための装置の説明図である。

【符号の説明】

- 1 金属よりなる内筒
- 2 内面を誘導体でライニングを行った外筒
- 3 ポルト
- 4 軸受
- 5 "
- 20 6 減速モーター
 - 7 刷子
 - 8 "
 - 9 ガス導入口
 - 10 袋
 - 11 ホッパー
 - 12 ナット
 - 13 スクリューコンペアー
 - 14 フランジ
 - 15 粉体の取出口

[図1]

